



(South Korea)

## EVG supplies maskless exposure system to PMT – January 24, 2024

### IT·산업

- 입력 2024.01.24 17:03

EVG, 피엠티에 마스크리스 노광 시스템 공급

MLE 기술 적용, 2m L/S 분해능 및 고밀도 재배선 등 지원

글로벌 반도체 기업 EV Group(이하 EVG, 지사장 윤영식)이 웨이퍼 프로브 카드 기업 피엠티(대표 조용)에 마스크리스 노광 시스템 'LITHOSCALE'을 공급한다고 24일 밝혔다.

왼쪽부터 조용호 피엠티 대표이사, 윤영식 EVG 지사장

노광 시스템은 마스크에 빛을 통과시켜 웨이퍼에 회로를 새겨넣는 시스템으로, 이번 계약을 통해 LITHOSCALE은 피엠티 본사에 설치되어 첨단 NAND, DRAM, 고대역폭 메모리(HBM) 디바이스의 웨이퍼 레벨 테스트용 차세대 MEMS 기반 프로브 카드 제조에 사용될 예정이다.

MLE(Maskless Exposure) 기술을 적용한 LITHOSCALE은 실시간 데이터 전송과 즉각적인 노광을 지원하는 디지털 프로세싱 기술이 탑재됐다. 높은 구조적 분해능 및 생산 처리량 확장성을 결합함으로써, 기존 리소그래피 방식의 병목 문제를 해결한다.

뒤로멈춤앞으로

특히 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems, 미세 전자 기계 시스템) 제조는 특히 미세공정의 복잡성으로 인해 공정 난이도가 높으며, 그 결과 마스크 제조비용 증가를 피할 수 없는 한계가 있다. 마스크를 사용하지 않는 LITHOSCALE은 높은 초점 심도와 고분해능(2m 수준의 L/S(Lines & Spaces))의 성능을 보장함에 따라, 마스크를 사용하지 않고도 미세 피치 프로브 카드의 핵심 기술인 고밀도 재배선 레이어(RDL)와 비아(Via) 연결을 지원한다.

윤영식 EVG 지사장은 “피엠티가 자사 제품 포트폴리오를 확장하고 개발 시간을 단축할 수 있도록 돕게 되어 매우 기쁘다.”라며, “LITHOSCALE은 높은 분해능, 다양한 많은 제품 설계를 처리할 수 있는 뛰어난 유연성, 낮은 소유 비용 특성을 결합한 독창적인 솔루션으로서, 미세 피치 웨이퍼 프로브 카드 제조용으로 매우 이상적”이라고 말했다.

출처 : 지티티코리아(<https://www.gttkorea.com>)

<https://www.gttkorea.com/news/articleView.html?idxno=8479>